

第79回分析基礎セミナー

実践！機器分析【1】

走査電子顕微鏡

【日時】 2014/4/16（水） 13:00-17:00

【場所】 九州大学伊都キャンパス・工学部大講義室（総合学習プラザ2F）

【主催】 九州大学中央分析センター伊都分室

【共催】 ナノテクノロジープラットフォーム

【協力】 株式会社日立ハイテクノロジーズ

13:00-14:00 SEM基礎講座

SEMの一般的な理論、装置の構成、得られる信号とその特性についてや、目的に応じたSEMの観察条件設定方法について解説します。

14:00-15:00 SEM観察の前処理技術

SEMの性能を引き出すためにはサンプルの特性に応じた前処理が必要です。試料台へのマウント方法やコンタミを除去する前処理および、目的に応じた加工前処理について解説します。

15:00-15:15 休憩

15:15-16:10 実試料を用いた多角的な解析手法の紹介

SEMでは各種オプション検出器を含めてさまざまな情報を得ることが出来ます。二次電子や反射電子を用いた多角的な観察から、X線を用いた分析や結晶方位の同定など、種々の観察や分析について、実践的な応用例を紹介します。

16:10-17:00 SEMの最新テクニックの紹介

3D観察やクライオ観察に加え、最近注目されているイオン液体のSEMへの応用等新たな観察手法を紹介いたします。

分析基礎セミナーは今年で8年目です。今年度は、基礎に加えて実際にデータを取得する上で役立つ内容に重点をおきます。現場で困っている方、よりよいデータを取得されたい方にも有用です。学内外どなたでもご参加できます。事前の参加登録にご協力お願いします。途中入退室も自由ですのでご都合に合わせてご参加ください。

【問合せ・申込先】

九州大学中央分析センター伊都分室 渡辺 Tel092-802-2857
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp